

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 4 年 7 月 29 日(2022.7.29)

【公開番号】特開 2021-182601(P2021-182601A)
【公開日】令和 3 年 11 月 25 日(2021.11.25)
【年通号数】公開・登録公報 2021-057
【出願番号】特願 2020-88016(P2020-88016)
【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 6 6 (2 0 0 6 . 0 1)

10

G 0 1 B 1 5 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 1 L 2 1 / 6 6 J

G 0 1 B 1 5 / 0 0 K

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 7 月 20 日(2022.7.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

動作制御部 5 は、孤立パターンであると決定された C A D パターン 1 0 1 に対応する実パターンの幅を測定する。具体的には、図 3 に示す画像 1 3 0 上の実パターン 1 2 1 (図 2 の C A D パターン 1 0 1 に対応する)の幅の寸法(Critical Dimension)を測定する。一実施形態では、動作制御部 5 は、パターンの特徴量として実パターン 1 2 1 の面積および/または扁平率をさらに算定してもよい。また、一実施形態では、動作制御部 5 は、パターンの特徴量として、実パターン 1 2 1 の全体の位置ずれ、すなわち、実パターン 1 2 1 と、対応する C A D パターン 1 0 1 とのずれ量を測定してもよい。

30

40

50